

# 低周波シールド対応

For Low Frequency Waves

ニッケル-鉄合金めっき

Nickel-iron Alloy Plating

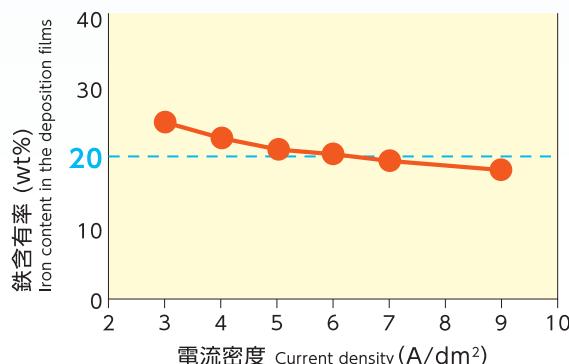
## 電気めっき用添加剤 トップフェニックLFS

Additives for nickel-iron alloy plating: TOP FENICK LFS

- ニッケル-鉄合金めっきで100kHz以下の低周波(磁界)対策  
Low frequency (magnetic field) shielding below 100kHz with nickel-iron alloy plating
- 添加剤で3価鉄の発生を抑制し、浴の安定性が向上  
Additives suppress trivalent iron generation and improve bath stability
- 幅広い電流密度で安定した鉄合金比率が得られる  
Stable iron-alloy ratio over a wide range of current densities

### 安定した鉄合金比率

Stable iron content in the deposition films



幅広い電流密度で  
鉄合金比率20wt%前後を維持  
Maintain about 20% by weight iron content  
in the deposition films at wide current density areas

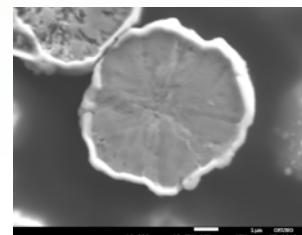
## 無電解めっき液 トップケミフェニック

Electroless nickel-iron alloy plating solution: TOP CHEMIFENICK

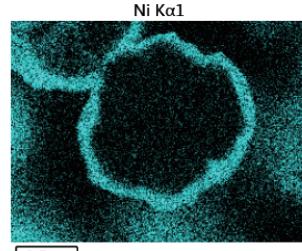
- 浴は安定で均一析出性に優れる無電解ニッケル-鉄合金めっき液  
Electroless nickel-iron alloy plating solution, great bath stability and deposition uniformity
- 導電性のない樹脂粉体などにも均一な皮膜を形成  
Uniform film can be formed on resin powder that does not show conductivity
- 優れた低保磁力・高磁束密度の軟磁性めっき皮膜が得られる  
Excellent in low coercivity, can obtain soft-magnetic plated films with high magnetic flux density

### 粉体表面にも均一に析出

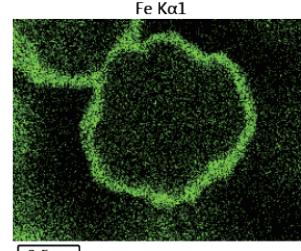
Uniform film can be formed on a resin powder



断面SEM像  
SEM image of cross section



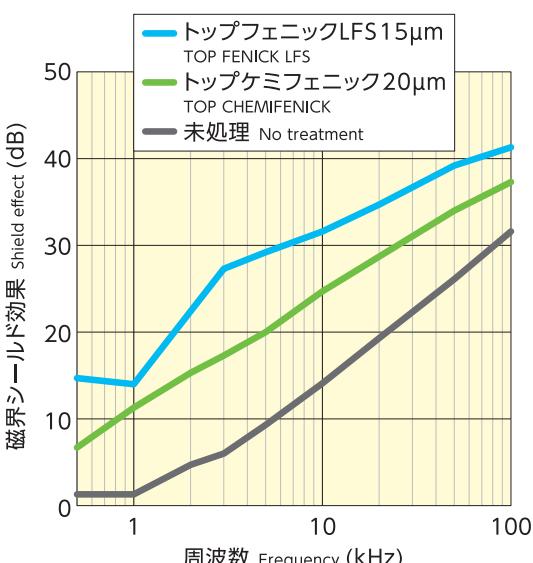
Ni K $\alpha$ 1  
2.5μm



Fe K $\alpha$ 1  
2.5μm

## 低周波シールド効果が向上

Improve shield effect to low frequency waves



シールド材試験方法：KEC法  
Shield material test method KEC method

両面めっき 素材：銅板 (板厚0.3mm)  
Both sides Substrate: Copper plate thickness

## 標準条件

Standard condition

### トップフェニックLFS TOP FENICK LFS

硫酸ニッケル六水和物 Nickel (II) sulfate hexahydrate	180g/L
塩化ニッケル六水和物 Nickel (II) chloride hexahydrate	45g/L
硫酸第一鉄七水和物 Iron(II) sulfate heptahydrate	40g/L
ホウ酸 Boric acid	40g/L
トップフェニックLFS-S TOP FENICK LFS-S	5mL/L
トップフェニックLFS-G TOP FENICK LFS-G	40mL/L
アクナH ACNA H	3mL/L
pH	2.2
浴温 Bath temperature	40°C
搅拌 Agitation	搖動・液循環 Shaking/rocking of substrate, circulation by pump
陰極電流密度 Cathode current density	6A/dm <sup>2</sup>
陽極 Anode	ニッケル Nickel

### トップケミフェニック TOP CHEMIFENICK

トップケミフェニックA TOP CHEMIFENICK A	800mL/L
トップケミフェニックB TOP CHEMIFENICK B	60mL/L
pH	8.3
浴温 Bath temperature	80°C
搅拌 Agitation	搖動・液循環 Shaking/rocking of substrate, circulation by pump